

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第1部門第2区分

【発行日】平成20年4月3日(2008.4.3)

【公表番号】特表2007-522887(P2007-522887A)

【公表日】平成19年8月16日(2007.8.16)

【年通号数】公開・登録公報2007-031

【出願番号】特願2006-554259(P2006-554259)

【国際特許分類】

A 6 1 N 1/20 (2006.01)

【F I】

A 6 1 N 1/20

【手続補正書】

【提出日】平成20年2月18日(2008.2.18)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板と結合した多数の第一のリザーバと、ここで該多数の第一のリザーバの内の選択されたリザーバが、還元剤を含み、かつ該多数の第一のリザーバの内の選択されたものの、第一リザーバ表面が、第一基板表面と近接しており、

該基板と結合した多数の第二のリザーバとを含み、ここで該多数の第二のリザーバの内の選択されたリザーバが、酸化剤を含み、かつ該多数の第二のリザーバの内の選択されたものの、第二リザーバ表面が、該第一基板表面と近接していることを特徴とする、装置。

【請求項2】

第一の基板表面および第二の基板表面を持つ基板と；

該基板と結合した、第一の材料組成物製の、多数の第一のリザーバと、ここで該多数の第一のリザーバから選択された第一リザーバ表面が、該第一の基板表面において露出しており、かつ該第一の材料組成物が第一の電位を有し；

該多数の第一のリザーバに隣接する、該基板と結合した、第二の材料組成物製の多数の第二のリザーバとを含み、ここで該多数の第二のリザーバから選択された第二リザーバ表面が、該第一の基板表面において露出し、かつ該第一リザーバ表面の内の隣接するものとは、物理的に分離しており、また該第二の材料組成物が第二の電位を有し、該第二の電位が、該第一の電位とは異なっている、ことを特徴とする装置。

【請求項3】

第一の表面を持つ基板と；

装置と結合した、多数の間隔を置いて配置された、異種のリザーバとを含み、ここで該装置は、電氣的に独立であり、かつ活性化した際に、外部電源を必要とすること無しに、該多数の間隔を置いて配置された、1またはそれ以上の、異種のリザーバ間に、電流を発生することができる、ことを特徴とする装置。

【請求項4】

基板と、

該基板と結合した、多数の第一のリザーバと、ここで該多数の第一のリザーバの内の選択されたリザーバが、還元剤を含み、かつ該多数の第一のリザーバの内の選択されたものの、第一リザーバ表面が、第一基板表面と近接しており；

該基板と結合した多数の第二のリザーバとを含み、ここで該多数の第二のリザーバの内

の選択されたリザーバが、酸化剤を含み、かつ該多数の第二のリザーバの内の選択されたものの、第二リザーバ表面が、該第一基板表面と近接していることを特徴とする、組織接触装置。

【請求項 5】

可撓性の基板と；

該基板と結合した、多数の第一のリザーバと、ここで該多数の第一のリザーバの内の選択されたリザーバが、還元剤を含み、かつ該多数の第一のリザーバの内の選択されたものの、第一リザーバ表面が、第一基板表面と近接しており；

該基板と結合した多数の第二のリザーバとを含み、ここで該多数の第二のリザーバの内の選択されたリザーバが、酸化剤を含み、かつ該多数の第二のリザーバの内の選択されたものの、第二リザーバ表面が、該第一基板表面と近接している、ことを特徴とする、創傷用の包帯。

【請求項 6】

実質的に目の表面の輪郭を持つように形成された基板と；

該基板と結合した、多数の第一のリザーバと、ここで該多数の第一のリザーバの内の選択されたリザーバが、還元剤を含み、かつ該多数の第一のリザーバの内の選択されたものの、第一リザーバ表面が、第一基板表面と近接しており；

該基板と結合した多数の第二のリザーバとを含み、ここで該多数の第二のリザーバの内の選択されたリザーバが、酸化剤を含み、かつ該多数の第二のリザーバの内の選択されたものの、第二リザーバ表面が、該第一基板表面と近接していることを特徴とする、目と接触する装置。

【請求項 7】

実質的に耳管の輪郭を持つように形成された基板と；

該基板と結合した、多数の第一のリザーバと、ここで該多数の第一のリザーバの内の選択されたリザーバが、還元剤を含み、かつ該多数の第一のリザーバの内の選択されたものの、第一リザーバ表面が、第一基板表面と近接しており；

該基板と結合した多数の第二のリザーバとを含み、ここで該多数の第二のリザーバの内の選択されたリザーバが、酸化剤を含み、かつ該多数の第二のリザーバの内の選択されたものの、第二リザーバ表面が、該第一基板表面と近接していることを特徴とする、耳管インサート。

【請求項 8】

実質的に腔領域内表面の輪郭を持つように形成された基板と；

該基板と結合した、多数の第一のリザーバと、ここで該多数の第一のリザーバの内の選択されたリザーバが、還元剤を含み、かつ該多数の第一のリザーバの内の選択されたものの、第一リザーバ表面が、第一基板表面と近接しており；

該基板と結合した多数の第二のリザーバとを含み、ここで該多数の第二のリザーバの内の選択されたリザーバが、酸化剤を含み、かつ該多数の第二のリザーバの内の選択されたものの、第二リザーバ表面が、該第一基板表面と近接していることを特徴とする、腔内装置。

【請求項 9】

可撓性の基板と；

該基板と結合した、多数の第一のリザーバと、ここで該多数の第一のリザーバの内の選択されたリザーバが、還元剤を含み、かつ該多数の第一のリザーバの内の選択されたものの、第一リザーバ表面が、第一基板表面と近接しており；

該基板と結合した多数の第二のリザーバとを含み、ここで該多数の第二のリザーバの内の選択されたリザーバが、酸化剤を含み、かつ該多数の第二のリザーバの内の選択されたものの、第二リザーバ表面が、該第一基板表面と近接していることを特徴とする、内部人工装具。

【請求項 10】

基板と、多数の第一のリザーバとを結合する工程と、ここで該多数の第一のリザーバの

内の選択されたりザーバは、還元剤を含み、かつ該多数の第一のりザーバの内の選択されたものの、第一りザーバ表面は、第一基板表面と近接しており；

該基板と、多数の第二のりザーバとを結合する工程とを含み、ここで該多数の第二のりザーバの内の選択されたりザーバが、酸化剤を含み、かつ該多数の第二のりザーバの内の選択されたものの、第二りザーバ表面が、該第一基板表面と近接していることを特徴とする、装置の製造方法。

【請求項 1 1】

生物組織の所定領域を処置するための装置であって、該装置が、

基板と結合した多数の第一のりザーバと、ここで該多数の第一のりザーバの内の選択されたりザーバが、還元剤を含み、かつ該多数の第一のりザーバの内の選択されたものの、第一りザーバ表面が、第一基板表面と近接しており、

該基板と結合した多数の第二のりザーバとを含み、ここで該多数の第二のりザーバの内の選択されたりザーバが、酸化剤を含み、かつ該多数の第二のりザーバの内の選択されたものの、第二りザーバ表面が、該第一基板表面と近接していることを特徴とする、上記装置。

【請求項 1 2】

生物組織（ヒトの組織を除く）の所定領域を処置する方法であって、該方法が、該生物組織の所定領域に所定の装置を適用する工程を含み、該装置が、

基板と結合した多数の第一のりザーバと、ここで該多数の第一のりザーバの内の選択されたりザーバが、還元剤を含み、かつ該多数の第一のりザーバの内の選択されたものの、第一りザーバ表面が、第一基板表面と近接しており、

該基板と結合した多数の第二のりザーバとを含み、ここで該多数の第二のりザーバの内の選択されたりザーバが、酸化剤を含み、かつ該多数の第二のりザーバの内の選択されたものの、第二りザーバ表面が、該第一基板表面と近接していることを特徴とする、上記方法。